

경사형 회전식 플라즈마 강화 화학 기상 증착(Pecvd) 튜브기로

품목 번호: KT-PE16



소개

정밀한 박막 증착을 위한 고급 PECVD 튜브기로입니다. 균일한 가열, RF 플라즈마 소스, 맞춤형 가스 제어 기능을 갖추고 있습니다. 반도체 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

퍼니스 모델	PE-1600-60
최대 온도	1600°C
일정 작업 온도	1550°C
퍼니스 튜브 재질	고순도 Al2O3 튜브
퍼니스 튜브 직경	60mm
가열 구역 길이	2x300mm
챔버 재질	일본산 알루미늄 파이버
가열 요소	이규화 몰리브덴(MoSi2)
가열 속도	0-10°C/min
열전대	B 타입
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러/터치 스크린 PID 컨트롤러
온도 제어 정확도	±1°C
RF 플라즈마 유닛	
출력 전력	5-500W 조절 가능 (± 1% 안정성)
RF 주파수	13.56 MHz ±0.005% 안정성
반사 전력	최대 350W
매칭	자동
소음	<50 dB
냉각	공랭식
가스 정밀 제어 유닛	
유량계	MFC 질량 유량계
가스 채널	4채널
유량	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCCM CH4 MFC3: 0-100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
선형성	±0.5% F.S.

반복성	±0.2% F.S.
배관 및 밸브	스테인리스 스틸
최대 작동 압력	0.45MPa
유량계 컨트롤러	디지털 노브 컨트롤러/터치 스크린 컨트롤러
표준 진공 유닛(옵션)	
진공 펌프	로터리 베인 진공 펌프
펌프 유량	4L/S
진공 흡입 포트	KF25
진공 게이지	피라니/저항 실리콘 진공 게이지
정격 진공 압력	10Pa
고진공 유닛(옵션)	
진공 펌프	로터리 베인 펌프 + 분자 펌프
펌프 유량	4L/S + 110L/S
진공 흡입 포트	KF25
진공 게이지	복합 진공 게이지
정격 진공 압력	6x10 ⁻⁵ Pa
위 사양 및 설정은 맞춤화 가능합니다.	

번호	설명	수량
1	퍼니스 본체	1
2	석영 튜브	1
3	진공 플랜지	2
4	튜브 단열 블록	2
5	튜브 단열 블록 후크	1
6	내열 장갑	1
7	RF 플라즈마 소스	1
8	정밀 가스 제어 장치	1
9	진공 유닛	1
10	사용 설명서	1